ROZKŁAD ZAJĘĆ KWP rok III sem.6 2022/2023

	08.03.2023	1 tydzień	2 tydzień	3 tydzień	4 tydzień	5 tydzień	6 tydzień	7 tydzień	8 tydzień	9 tydzień	10 tydzień	11 tydzień	12 tydzień	13 tydzień	14 tydzień online	15 tydzień online	16 tydzień online	17 tydzień	
	0.202	27.02	6.03	13.03	20.03	27.03	3.04	10.04	17.04	24.04	1.05	8.05	15.05	22.05	29.05	12.06	19.06	26.06	3.07 odrabianie	Data
	Gr. L.	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	
PONIEDZIAŁEK	8 - 9							Przerwa świateczna											8 - 9
	9 - 10													Inżynieriia powierzchni P s.201					9 - 10
	10 - 11																		10 - 11
	11 - 12																		11 - 12
	12 - 13																		12 - 13
	13 - 14																		13 - 14
	14 - 15																		14 - 15
	15 - 16																		15 - 16
	16 - 17																		16 - 17
	17 - 18																		17 - 18
	18 - 19																		18 - 19
	Data	28.02	7.03	14.03	21.03	28.03	4.04	11.04	18.04	25.04	2.05	9.05	16.05	23.05	30.05	13.06	20.06	27.06	04.07 odrabianie	Data
WTOREK	8 - 9	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Przerwa świateczna	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metal odlew niez L s. 32		Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201	Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych W s.201						8 - 9
	9 - 10																			9 - 10
	10 - 11																			10 - 11
	11 - 12	Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II W s.110	Inżynieri pow L s. 54	Inżynieri pow L s. 54	Inżynieri pow L s. 54	Inżynieri pow L s. 54	Metal odlew niez L s. 32		Metal odlew niez L s. 32	Inżynieri pow L s. 54		Metal odlew niez L s. 32	Metal odlew niez L s. 32	Badania def L s. 61	Badania def L s. 61					11 - 12
	12 - 13																			12 - 13
	13 - 14	Bazy danych program bazodanowe W s. 108	Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II W s.109	Symulacje L s.109	Symulacje L s.109	Symulacje L s.109	Symulacje L s.109		Symulacje L s.109	Symulacje L s.109		Symulacje L s.109	Symulacje L s.109	Symulacje L s.109	Symulacje L s.109					13 - 14
	14 - 15																			14 - 15
	15 - 16																			15 - 16
	16 - 17																			16 - 17
	17 - 18																			17 - 18
	18 - 19																			18 - 19
	Data	1.03	8.03	15.03	22.03	29.03	5.04	12.04	19.04	26.04	3.05	10.05	17.05	24.05	31.05	14.06	21.06	28.06	05.07 odrabianie	Data
ŚRODA	8 - 9	Inżynieriia powierzchni W s.201	Inżynieriia powierzchni W s.201	Inżynieriia powierzchni W s.201	Inżynieriia powierzchni W s.201	Inżynieriia powierzchni W s.201	Inżynieriia powierzchni W s.201	Przerwa świateczna	Inżynieriia powierzchni P s.201	Inżynieriia powierzchni P s.201		Inżynieriia powierzchni P s.201	Inżynieriia powierzchni P s.201	Inżynieriia powierzchni P s.201	Inżynieriia powierzchni P s.201					8 - 9
	9 - 10																			9 - 10
	10 - 11																			10 - 11
	11 - 12	Bazy danych program bazodanowe W s. 108	Bazy danych program bazodanowe W s. 108	Bazy danych program bazodanowe S s. 108	Bazy danych program bazodanowe W s. 108	Bazy danych program bazodanowe W s. 108	Bazy danych program bazodanowe W s. 108		Bazy danych program bazodanowe S s. 108	Mikro L s.602		Mikro L s.602	Mikro L s.602	Mikro L s.602	Mikro L s.602					11 - 12
	12 - 13				Mikro i analiza strukt CA s.602	Mikro i analiza strukt CA s.602	Mikro i analiza strukt CA s.602													12 - 13
	13 - 14								Mikro i analiza strukt CA s.602	Mikro i analiza strukt CA s.602		Mikro i analiza strukt CA s.602	Mikro i analiza strukt CA s.602	Mikro i analiza strukt CA s.602						13 - 14
	14 - 15						Badania defektoskop W s.603		Badania defektoskop W s.603	Badania defektoskop W s.603		Badania defektoskop W s.603								14 - 15
	15 - 16			Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II W s.603	Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II W s.603															15 - 16
	16 - 17																			16 - 17
	17 - 18																			17 - 18

Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II	15/0/30/0/0	KISIKO
Mikroskopia i analiza struktury	30/15/15/0/0	KISIKO
Badania defektoskopowe	10/0/5/0/0	KTFTFIOMN
Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych	30/0/15/0/0	KTFTFiOMN
Przedmiot obieralny- (4)		
Inżynieria powierzchni	30/0/15/15/0	KCKM
Technologia antykorozyjna	30/0/15/15/0	KCKM
BLOK OBIERALNY wybór jednego bloku		
BLOK OBIERALNY IV:		
Techniki generatywne	15/0/0/0/5	KIPO
Bazy danych programowanie bazodanowe	15/0/0/0/5	KIPO
Modelowanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej	15/0/0/0/5	KIPO
BLOK OBIERALNY V:		
Modelowanie i symulacja naprężeń mechanicznych w od	15/0/0/0/5	KIPO
Modelowanie i symulacja procesów korozyjnych	15/0/0/0/5	KCKM
Modelowanie i symulacja przepływów	15/0/0/0/5	KIPO

	18 - 19																			18 - 19
CZWARTEK	Data	2.03	9.03	16.03	23.03	30.03	6.04	13.04	20.04	27.04	4.05	11.05	18.05	25.05	1.06	15.06	22.06	29.06 odrabianie	6.07	Data
	8 - 9						Przerwa świąteczna		Techniki generatywne W s.606	Techniki generatywne W 2+S1 s.606	Techniki generatywne W 2+S1 s.606	Techniki generatywne W 2+S1 s.606	Techniki generatywne W 2+S1 s.606	Techniki generatywne W 2+S1 s.606	Techniki generatywne W 2+S1 s.606				sesja podstawowa	8 - 9
	9 - 10																			9 - 10
	10 - 11																			10 - 11
	11 - 12		Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.606	Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.606	Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.606	Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.606		Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.606			Mikro i analiza strukt W s.505	Mikro i analiza strukt W s.505	Mikro i analiza strukt W s.505	Mikro i analiza strukt W s.505	Mikro i analiza strukt W s.505					11 - 12
	12 - 13																			12 - 13
	13 - 14																			13 - 14
	14 - 15									Inzynieriia powierzchni W s.506	Inzynieriia powierzchni W s.506	Inzynieriia powierzchni W s.506			Inzynieriia powierzchni W s.506					14 - 15
	15 - 16																			15 - 16
	16 - 17																			16 - 17
	17 - 18																			17 - 18
	18 - 19																			18 - 19
PIĄTEK	Data	3.03	10.03	17.03	24.03	31.03	7.04	14.04	21.04	28.04	5.05	12.05	19.05	26.05	2.06	16.06	23.06	30.06 odrabianie	7.07	Data
	8 - 9	Badania defektoskop W s.102					Przerwa świąteczna												sesja podstawowa	8 - 9
	9 - 10																			9 - 10
	10 - 11	Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.102	Mikro i analiza strukt W s.201	Mikro i analiza strukt W s.201	Mikro i analiza strukt W s.201	Mikro i analiza strukt W s.201		Mikro i analiza strukt W s.201												10 - 11
	11 - 12																			11 - 12
	12 - 13	Model i optymalizacja zuzycia energii W + S s.102																		12 - 13
	13 - 14																			13 - 14
	14 - 15																			14 - 15
	15 - 16																			15 - 16
	16 - 17																			16 - 17
	17 - 18																			17 - 18
	18 - 19																			18 - 19